

## ZEEnit 700 – Compact Design for Flame and Graphite-Furnace AAS



### ZEEnit<sup>®</sup> 700—火焰和塞曼石墨炉一体化原子吸收

#### 现代化节省空间的仪器设计 — 市场上 总体积最小的原子吸收

##### 双原子化器设计

火焰和石墨炉原子化器同时集成在同一主机上，在火焰、氢化物 and 石墨炉技术之间自动切换不需任何机械移动。

不需拆换原子化器、不需移动石墨炉自动进样器、不需任何重校。

通过简单的软件控制完成不同原子化技术的自动切换。

两种校正模式可供选择：氘灯或塞曼背景校正。

各种高端技术集结于同一系统中：

横向加热石墨炉；三磁场塞曼技术；

直接固体进样分析；

氢化物-石墨炉联用技术；

全智能化自动样品系统等……

#### 超群的分析性能同简便的操作完美的结合于一身

分析条件自动优化：

燃气比例流量、燃烧头高度、灰化温度、磁场强度，二磁场和三磁场校正模式等……

## ZEEnit® 700

更换石墨炉部件极为方便,无需校准:  
 按动一个按钮即可将石墨炉移出(特殊的停放位)。

用自动格式化程序测试石墨炉部件性能进行自动温度校正。

拥有专利横向加热的针式平台的最新石墨管技术,通过较低的原子化温度和业已证明的加热设计保证了石墨管的长寿命和优异的分析性能。

由软件结合循环计数器监视石墨管和石墨炉各部件寿命。

石墨炉内部照明器最佳化的高级监视系统检测方法开发和样品注入的准确性。

### MPE60Z 智能化自动进样器

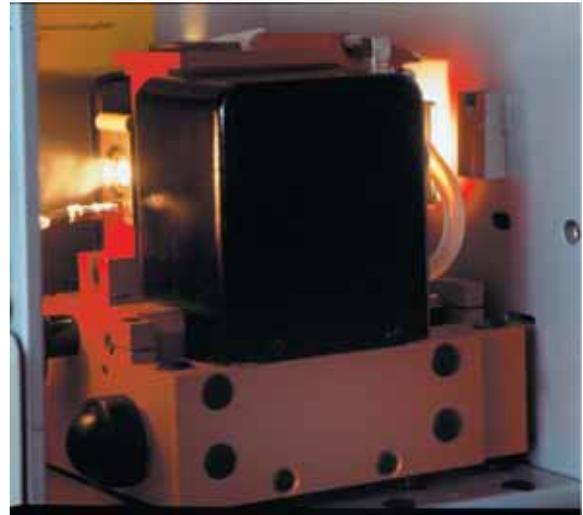
能够进行更多的自动样品测量:  
 智能化自动稀释和富集  
 自动除残  
 交叠进样提高样品分析速度  
 热注射功能  
 自动调节注射深度

全部分析参数都被存储在方法中。

### 光谱仪器的火眼金睛:我们所有光学元件都符合所有优异的标准典范

多年以来,我们的光学系统一致遵循一套基本准则:

- 使用最少的光学元件数,将光能量损失减至最低
- 非球面光学元件保证最佳的成像质量
- 光学元件使用石英涂层和特殊密封技术处理,能够长年耐受恶劣实验室气氛的侵蚀
- 采用高性能的单色器,并且可以任意转换单光束和双光束模式,这一技术是独一无二的。



横向加热石墨炉

### 自动控制火焰和氢化物技术的成功的严谨设计

很高的样品处理能力,灵活性和高效性保证了双原子化器设计、先进的软件模块和多样的附件。通过全自动化、智能化样品稀释满足不同样品和元素的分析,改善精度。

独一无二的背景基线校正方法可优化火焰发射模式的准确分析方法。

可调节的撞击球与原子化器的惰性混合室相结合使全部样品高效原子化,完全的自动化气体控制由总流量气体模块控制,是自动火焰高度校准和火焰参数自动优化的结合体

使用 SFS5(分段流动注射装置)的注射技术能够直接测定极少样品量和高基体含量的样品并稳定燃烧条件。